JP63225153 METHOD FOR INSPECTING SUBSTRATE OMRON TATEISI ELECTRONICS CO

Inventor(s): ; UTSUNOMIYA SHUNJI ; TAKAHARA HIDEAKI Application No. 62057941, Filed 19870314, Published 19880920

Abstract: PURPOSE: To certainly perform inspection, by a method wherein not only a pre-flux emitting fluorescence having a wavelength #lambda#1 but also an adhesive emitting fluorescence having a wavelength #lambda#2 are applied to a substrate to mount a part thereto and the image of the substrate is picked up to discriminate the color of the image pickup result.

CONSTITUTION: A pre-flux containing an ultraviolet ray excitative luminescent agent emitting green fluorescence is applied to a substrate 25 to form a fluorescent film, and an adhesive containing an ultraviolet ray excitative luminescent agent emitting red fluorescence and a solder paste emitting green fluorescence are applied to a part mounting a part 21a and the part 21a is mounted to form a standard substrate 20a. A substrate 20b to be inspected is formed in the same manner. Then, the color levels of pixels outputted from an image pickup part 17 are discriminated to judge the mount state and the parameter of the part 21a is compared with hat of a part 21b to detect the detachment and positional shift of the part 21b. Therefore, even when the colors of the parts are same, the detachment and positional shift of the part can be certainly detected.

COPYRIGHT: (C)1988,JPO&Japio

Int'l Class: G01N02188; G01N02191 H01L02166 H05K01308

MicroPatent Reference Number: 000108164

COPYRIGHT: (C)JPO

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑩ 公開特許公報(A)

昭63-225153

@Int_Cl.4

H 05 K

識別記号

庁内整理番号

43公開 昭和63年(1988)9月20日

G 01 N 21/88 21/91 H 01 L 21/66 F-7517-2G -7517-2G

6851-5F

-6921-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全8頁)

⑤発明の名称

基板検査方法

②特 館 昭62-57941

願 昭62(1987)3月14日 ②出

②発 明 都宮 老

13/08

京都府京都市右京区花園中御門町3番地 株式会社立石ラ

イフサイエンス研究所内

②発 明 沯 原 高

明 秀

俊二

京都府京都市右京区花園中御門町3番地 株式会社立石ラ

イフサイエンス研究所内

立石電機株式会社 创出 人

京都府京都市右京区花園土堂町10番地

弁理士 岩倉 多代 理 哲二 外1名

1. 発明の名称

基 板 検 壺 方 法

2. 特許請求の範囲

基板を撮像して得られたデータを処理して前記 基板上の部品を検査する基板検査方法において、 波長入1の蛍光を発する励起蛍光剤を含むプリフ ラックスが娘布されるとともに、彼長入2の役光 を発する励起蛍光剤を含む接着剤が塗布され機、 部品が実装された基板に光を当てながらこの基板 を撮像し、この機能結果の色を識別して前記部品 のマウント状態を検査することを特徴とする基板 検査方法。

3. 発明の詳細な説明

《産衆上の利用分野》

本発明は、基板を顕像して得られたデータを処 理して 前記基板上の部品 実装状態を検査する基板 検査方法に関する。

(従来の技術)

プリント延板に抵抗器や半導体素子等の各種チ

ツア都品をマウントするときにおいて自動マウン ト装牌を用いた場合、マウント後においてマウン トテータどうりに都品がマウントされていないこ とがある。

このため、このような自動マウント装置等を用 いた場合には、マウント後にプリント基板をチェ ツクして、このプリント基板上の正規の位置に正 当なチップ部品が正しい姿勢(位置、方向)でマ ウントされているかどうか、また脱落がないかど うかを検査する必要がある。

しかしこのような検査を従来と同じように人手 による目視検査で行つていたのでは、検査ミスの 発生を完全に無くすことができず、また検査速度 を茲めることができないという問題がある。

そこで、近年、この種の検査を自動的に行うこ とができるプリント基板の自動検査装置が各メー カから種々提案されている。

第6図は、このような自動検査装置の一例を示 すプロツク図である。

この図に示す自動検査装置は、部品1が実装さ

特開昭63-225153(2)

《発明が解決しようとする問題点》

ところでこの種の自動検査装置によって検査されるがはは、技板の地色と似ての分のははないのでは、対象がある。このないではいるが関係している。このため、この部はははいても、また位置すれ等を起こしている。これを検出することができないという問題があった。

本発明は上記の事情に鑑み、部品の色と、基板

部15と、照明部16と、機像部17と、処理部18とを備えており、基準基板20aを機像して得られた前記基準基板20a上にある各部品21 20bを機像して得られた前記被検査基板20b 上にある各部品21bのパラメータ(被検査データ)とを比較して、これらの各部品21bが脱落

していたり、位置すれ等を起こしているときに、

これを検出する。

X - Yテーブル部15は、前記処理部18からの制御信号に基づいて動作するパルスモータ22.23によってX 物方向および Y 物方向に駆動される X - Y テーブル 444 とを備えており、この X - Y テーブル 444 上にセットされた前記各基板20a.20 b は、照明部16によつて照明されながら扱像部17によって網像される。

この場合、前記基準基板20aは、次に述べるようにして作られている。

まず、両面(または、片面)に銅箔が張られた

の地色とが同じ場合や似ている場合でも、全部品についてもこれらが脱落していないか、位置ずれ 等を起こしていないかを検査することができる基 板検査方法を提供することを目的としている。

《問題点を解決するための手段》

上記の問題点を解決するために本発明によるタを 板検査方法は、基板を撮像とするのに、を発生の の理して、被長入1の供発を発するのは、 を含むプリフラックスが進布されるととが発力 を含むでは、がなまれたを発するのは光光を を含むため、があるととなりが を含むため、があるととを がらこの基板を顕像し、大概を検査することを 後のでしている。

(実施例)

第1回は、本発明による基板検査方法の一実施 例を適用した基板検査装置の一例を示すプロツク 図である。

この図に示す基板検査装置は、X-Yテーブル

また前記被検査基板 2 0 b も前記基準基板 2 0 a と同様な手順で作られる。

また照明部 1 6 は、前記処理部 1 8 からの制御信号に基づいてオン/オフ制御される光顔 (ブラックライト光源) 3 5 と、この光源 3 5 が発した 被長 3 0 0 ~ 4 3 0 mmの光を前記 X ~ Y テーブル 部 1 5 側に反射して前記各基板 2 0 a . 2 0 b か

特開昭63-225153(3)

らの光を透過させるハーフミラー36とを備えており、このハーフミラー36を透過した光は競像 都17に供給される。

随像部17は、前記照明部16の上方に設けられるTVカメラ(カラーTVカメラ)37を備えており、前記各基板20a.20bからの光は、このTVカメラ37によつて電気信号(画像信号)に変換されて処理部18に供給される。

この場合、第3図(A)に示す如く部品21a、21bが正しくマウントされていれば、このTVカメラ37から出力されるラインaの画像信号中、R借号は第3図(B)に示す如く接着剤28がはみいした部分だけが高いレベルになり、またG信号は第3図(C)に示す如く部品21a、21b部分と接着剤28部分とを除いた部分だけが高いレベルとなる。また前記画像信号中のB信号は、第3図(D)に示す如く部品21a,21bの極性マーク(白色)38部分だけが高いレベルとなる。

また第4図(A) に示す如く部品21a.21b が正しくマウントされていなければ、このTVカ

49と、制御部(CPU)50とを備えており、 テイーチングモードのとき、前記機像部177から 供給される面像信号(前記基準基板20aを部品 21aのパラメータを抵出しているのの部品 21aのパラメータをでは、これでのできるのでは、では、 を作成する。そのでは、では、 ないでは、

A / D 変換 都 4 0 は、前 記 機 像 都 1 7 から 画像 信号を供給されたときに、これを A / D 変換(ア ナログ・デジタル 変換)して 画像 データを作成し、 これを制御部 5 0 へ供給する。

またメモリ41は、RAM(ランダム・アクセス・メモリ)等を備えており、前記制御部50の作業エリアとして使われる。

メラ37から出力されるライン a の画像個号中、そのR信号は第4図(B) に示す如く接着剤 2 8 部分だけが高いレベルになり、また第4図(C) に示す如くそのG信号は接着剤 2 8 部分を除いた部分だけが高いレベルとなる。また前記画像信号中のB信号は、第4図(0) に示す如く全体的に低いレベルとなる。

したがつて、機像部17から出力される画像信号によって示される各画素の色レベルを識別させ、これら各画素が越板領域、接着剤領域、部局領域のどの領域に属するかを判定させることによつて部品21a,21bが正しくマウントされているかどうかを判定させることができる。

また処理都 1 8 は、A / D 変換部 4 0 と、メモリ 4 1 と、ティーチングテーブル 4 2 と、 画像処理部 4 3 と、判定部 4 4 と、X - Y ステージコントローラ 4 5 と、 は像コントローラ 4 6 と、C R T 表示部 4 7 と、ブリンタ 4 8 と、キーボード

また画像処理部43は、前記制御部50を介して画像データを供給されたとき、この画像データの色を設別して各部分が基板領域、接着削領域、 が品領域のどの領域に属するか判定するとともに、 この判定結果に基づいて部品の特徴を示す各種の パラメータを算出するように構成されており、こ こで得られた各パラメータは、前記制御部50や 判定都44へ供給される。

またティーチングテーブル42は、フロツピーディスク装置等を備えており、ティーチング時において前記制御部50から判定データファイル等を供給されたときに、これを記憶し、また検査時において、前記制御部50が転送疫求を出力したとき、この要求に応じて判定データファイル等を読み出して、これを制御部50などへ供給する。

また判定部44は、検査時において前記制御部50から判定データファイルを供給され、かつ前記画像処理部43から検査データを供給されたとき、これらを比較判定して、部品21bの有無、位置ずれ等を判定するように構成されており、こ

特開昭63-225153(4)

の判定結果は前記制御部50へ供給される。

また機像コントローラ46は、前記制御部50と前記照明部16、機像部17とを接続するインターフエース等を備えており、前記制御部50の出力に基づいて前記照明部16と、機像部17とを制御する。

また X - Y ステージコントローラ 4 5 は、前記 制御部 5 0 と前記 X - Y テーブル 2 1 5 とを接続 するインターフェース等を備えており、前記制御 部 5 0 の出力に基づいて前記 X - Y テーブル部 1 5 を制御する。

またCRT表示部47は、プラウン管(CRT)等を備えており、前記制御部50から画像データ、判定結果、キー入力データ等を供給されたとき、これを画而上に表示させる。

またプリンタ48は、前記制御部50から判定 結果等を供給されたとき、これを予め決められた 售式(フォーマツト)でプリントアウトする。

またキーボード49は、操作情報や前記基準基板20aに関するデータ、この基準基板20a上

にある部品 2 1 a に関するデータ等を入力するのに必要な各種キーを備えており、このキーボード4 9 から入力された情報やデータ等は、制御部5 0 へ供給される。

制御部50は、マイクロプロセツサ等を備えており、次に述べるように動作する。

まず、新たな被検査基板200を検査するときには、制御部50は第5図(A)に示すようにメインフローチャートのステップST1で第5図(B)のフローチャートで示されるティーチングルーチン51を呼出し、このティーチングルーチン51のステップST2で装置各部をイニシャライズして機像条件およびデータの処理条件を整えた後、ステップST3でX-Yテーブル部15上に基準基板20aが載せられるまで特つ。

そ し て 、 X - Y テープル 部 1 5 上に 基 準 基 板 2 0 a が 載 せ ら れ れ ば 、 制 御 部 5 0 は 前 記 ス テ ツ プ S T 3 か ら ス テ ツ プ S T 4 へ 分 岐 し 、 こ こ で X - Y テープル 部 1 5 を 制 御 し て T V カ メ ラ 3 7 の 下方に 基 準 基 板 2 0 a の 第 1 最 像 エ リ ア を 配 置 さ

せる。

この後、制御部50は、ステツプST5でTVカメラ37によつて得られた画像信号をA/D変換部40でA/D変換させるとともに、このA/D変換結果(基準基板20aの画像データ)をメモリ41にリアルタイムで記憶させる。

次いで、ステツプST6で、制御部50は、前記メモリ41から基準基板20aの画像データを読み出し、これを画像処理部43に供給してこの画像データを構成する各画素が基板領域、接着削領域、部品領域のどの領域に属するかを判定させた後、ステツプST7でこの判定結果に基づいて第1歳後エリア内にある各部品21aの特徴を示す各種のパラメータを抽出させる。

次いで、制御部50はステツプST8で前記各パラメータから各部品21aに関する判定データを作成する。

定データが得られるまで、前記ステップST7~ ST9を繰り返し実行する。

そして、これら各部品21aの全てについて判定データが得られたとき、制御部50は前記ステップST10へ分岐し、ここで基準基板20aの全機像エリアについて処理が終了したかどうかをチェックする。

そして、まだ処理されていない超像エリアが残つていれば、制御部50はこのステツプST10から前記ステツプST4に戻り、上述した動作を繰り返す。

そして、全観像エリアについて処理が終了したとき、制御部50は前記ステップST10からステップST11へ分岐し、ここで各部品21aについての各判定データから被検査基板20bを検査するのに必要な判定データファイルを作成し、これをティーチングテーブル42に記憶させた後、このティーチングルーチン51を核了する。

また、このティーチングルーチン 5 1 が終了し ・ て、検査モードにされれば、制御部 5 0 はメイン

特開昭63-225153(5)

フローチャートのステツプST12で第5図(C)のフローチャートで示される検査ルーチン52を呼出し、この検査ルーチン52のステツプST13でティーチングテーブル42やキーボード49からその日の日付けデータ、被検査基板20 bのIDナンバ(識別番号)を取り込むとともに、ティーチングテーブル42から判定データファイルを読み出して、これを判定部44に供給する。

そして、X - Y テーブル部 1 5 上に被検査基板 2 0 b が 載せられれば、制御部 5 0 は前記ステツプ S T 1 5 に分岐し、ここで X - Y テーブル部 1 5 を制御して T V カメラ 3 7 の下方に被検査基板 2 0 b の第 1 撮像エリアを配置させる。

次いで、制御部50はステツプST16でTV カメラ37によつて得られた画像信号をA/D 変 換部40でA/D変換させるとともに、このA/

記ステツプST15へ戻り、被検査基板20bの 残りの撮像エリアについて上述した処理を類次実 行する。

そして、全撮像エリアについて処理が終了したとき、制御部50は前記ステツプST20からステップST21に分岐し、ここでメモリ41に記憶されている各部品21bの判定結果を読み出して、これをCRT表示部47に表示させたり、プリンタ48からプリントアウトさせたりする。

(発明の効果)

以上説明したように木発明によれば、部品の色

D 変換結果(被検査基板 2 0 b の面像データ)を リアルタイムでメモリ 4 1 に記憶させる。

この後、制御郎 5 0 はステツプ S T 1 9 で前記被検査データを判定部 4 4 に転送させて、この被検査データと、前記判定データとを比較させて被検査基板 2 0 b 上の部品 2 1 b が欠落、位置ずれ、逆マウント、誤マウント等を起こしていないかどうかを判定させるとともに、この判定結果をメモリ 4 1 に記憶させる。

この後、制御郎50はステツプST20から前

と、越板の地色とが同じ場合や似ている場合でも、 全部品についてもこれらが脱落していないか、 位 置ずれ等を起こしていないかを商速に、かつ安価 に検査することができる。

4. 図面の簡単な説明

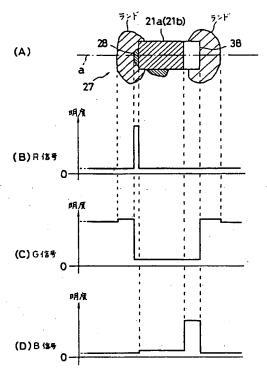
15 ··· X ·· Y テーブル部、16 ··· 照明部、17 ··· 短像部、18 ··· 処理部、20 a ··· 基板(基準基板)、20 b ··· 基板(被検査基板)、21 a ·

特開昭63-225153(6)

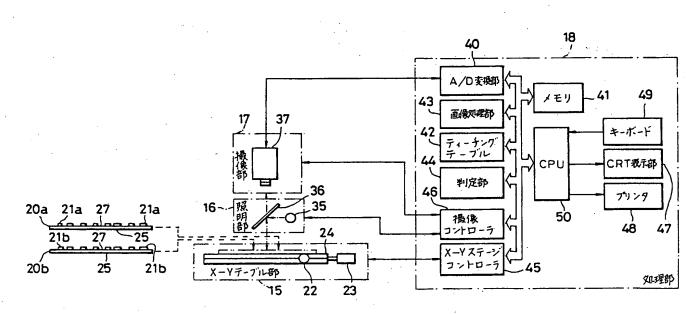
2 1 b ··· 部品、 2 6 ··· ブリフラツクス、 2 8 ··· 接 着剤。

代理人 弁理士 岩倉哲二(他1名)

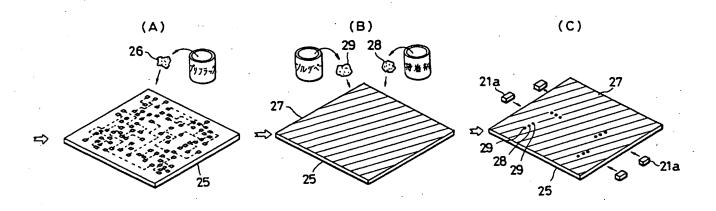
第 3 図



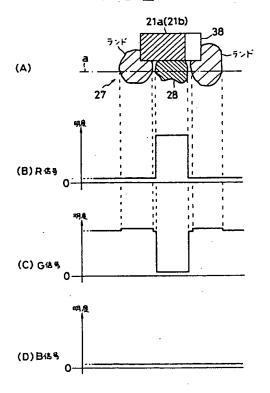
第 1 図

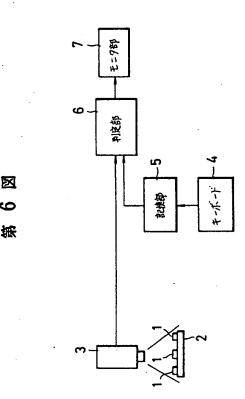


第 2 図



第 4 図





特開昭63-225153 (8)

第 5 図

